２００７年3月２０日

各　位

会社名　　日本精工株式会社
代表者名　朝香　聖一
（コード番号　６４７１　東証一部）
問合せ先　広報部長　永島　雅美
（ＴＥＬ　０３－３７７９－７０５０）

会社名　株式会社ブイ・テクノロジー
代表者名　杉本　重人
（コード番号　７７１７　東証マザーズ）
問合せ先　管理部長　中原　有庸
（ＴＥＬ　０４５－３３８－１９８０）

液晶ディスプレイ製造向け新方式露光装置に関する技術の実施許諾契約締結についてのお知らせ

日本精工株式会社（本社／東京都品川区　取締役 代表執行役社長　朝香聖一、以下NSK）と株式会社ブイ・テクノロジー（本社／神奈川県横浜市　代表取締役社長　杉本重人、以下ブイ・テクノロジー）は、本日、新方式露光装置EGIS（Exposure System Guided by Image Sensor）に関する技術の実施許諾契約を締結し、液晶ディスプレイ製造に適用される新方式露光装置EGISの製造・販売について協力していくことで合意しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

新方式露光装置 EGIS に関する技術実施許諾契約の締結および液晶ディスプレイ製造に適用されるEGISの製造・販売について協力していくことの合意により、ブイ・テクノロジーが開発した技術に基づき、NSK が保有する露光装置に関する豊富なノウハウならびに独自の安定した露光装置の製造体制の下、液晶ディスプレイメーカーに新方式の露光装置EGISを提供することが可能となります。また、NSKが従来より提供してきたプロキシミティ方式の露光装置とEGISと

の同時提案が可能になり、お客様のより効率的な液晶ディスプレイ製造プロセス構築に貢献します。

１． 業務協力の内容と狙い

両社は、NSK の持つ露光装置製造に関する技術とブイ・テクノロジーの持つ新方式露光装置 EGIS に関する技術を相互利用し、新方式の露光装置の製造・販売を実施します。液晶パネルメーカーは、EGIS を導入することにより、マスクのランニングコストを下げるとともに、製造プロセスの信頼性や製造の歩留まりを向上させ、大型液晶基板の製造コストの大幅な削減が可能になります。

２． 新方式の露光装置 EGIS の概要

液晶ディスプレイメーカーは、大型テレビ用ディスプレイパネルの生産効率向上のため、基板の大型化、新プロセスの採用等、設備投資を進めています。

ブイ・テクノロジーの開発した新方式の露光装置 EGIS は、小型マスクと画像検出ユニットからなる、In-situ Local Alignment System （インサイチュ･ローカル・アライメント・システム)を採用し、露光位置に近接したガラス基板上のパターンを認識し、マスクの精密位置決め制御を実現しました。

３． 今後の見通し

両社は新方式の露光装置 EGIS の製造・販売を協力して進め、2007 年 8 月の出荷開始を目指します。

また、現時点においては、NSK およびブイ・テクノロジーともに、当該 EGIS に関する技術実施許諾契約の締結を含む業務協力が今期の業績に与える影響は軽微であると予想しております。

【 参考情報（1）】

ＮＳＫの概要

ＮＳＫは、1916 年に創立し、国産第一号のボールベアリング（玉軸受）を世に送り出しました。以来、数々のタイプの軸受を開発、世界のすみずみまでに供給し、国内第一位、世界でも第三位のシェアを持っています。ＮＳＫは、軸受で長年培ってきたトライボロジー技術(潤滑によって摩擦をコントロールする科学・技術)をベースに、世界 No.1 のシェアを誇るボールねじをはじめ、リニアガイド、XY テーブルなどの直動製品やメガトルクモータ(ダイレクトドライブモータ)等の精密位置決めを行うメカトロ製品を提供しています。これらの製品は、各種工作機械、産業用ロボット、搬送装置から半導体・液晶製造装置、露光装置や医療機器、アミューズメントに至るまで、さまざまな分野で使用されています。また、メカトロ製品開発により培われた高度な駆動機構や電子制御技術を融合し、大画面液晶ディスプレイ用パターンを作る露光装置などのシステム製品も提供しています。

ブイ・テクノロジーの概要

ブイ・テクノロジーは、1997 年の設立以来、日本、韓国、台湾等の液晶パネル製造メーカー等のお客様に向けて、検査装置、修正装置、測定装置、観察装置等を製造、販売し、フラット・パネル・ディスプレイ（FPD）製造ラインの歩留まり向上のため、トータル・ソリューションを提供しております。特に、液晶カラーフィルター向けの修正装置は、客先の評価も高く、業界でトップ・シェアを持っています。従前より、当社のコア技術である、画像処理関連技術、超精密座標位置決め技術、ならびに微細加工技術等を展開、応用した装置開発に取組んできましたが、急激に進む FPD 産業の技術革新と成長をより強力にサポートしていく為、今回、ＮＳＫと業務協力を行う新方式の露光装置 EGIS をはじめ、MEMS 技術を応用した高さ計測ユニット等、つねに新しい技術（＝ソリューション）の研究・開発に注力し、業容拡大を目指しております。

【 参考情報（2）】

各当事者の概要（2006 年 9 月 30 日現在）

① 商号	日本精工株式会社	株式会社ブイ・テクノロジー
② 事業内容	産業機械軸受・自動車関連製品・精密機器関連製品の製造及び販売、その他の事業（機械設備等の製造・販売）	液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ関係の製造装置、検査装置、測定装置、観察装置、修正装置の製造販売
③ 設立年月日	1916 年 11 月 8 日	1997 年 10 月 16 日
④ 本店所在地	東京都品川区大崎一丁目 6 番 3 号	神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 番地
⑤ 代表者	取締役 代表執行役社長 朝香 聖一	代表取締役社長 杉本 重人
⑥ 資本金	67,176 百万円	2,178 百万円
⑦ 従業員数	23,259 名	116 名
⑧ 大株主	日本マスタートラスト信託銀行 ８．７％ 日本トラスティ・サービス信託銀行 ５．６％ 富国生命 ５．２％	杉本 重人 １１．０％ 日本トラスティ・サービス信託銀行 ４．７％ 日本マスタートラスト信託銀行 ３．４％
⑨ 当事会社の関係	資本関係・人的関係・取引関係ともに該当すべき事項はございません。	

以 上